

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第1区分
【発行日】平成26年3月27日(2014.3.27)

【公開番号】特開2012-177585(P2012-177585A)
【公開日】平成24年9月13日(2012.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2012-037
【出願番号】特願2011-39888(P2011-39888)
【国際特許分類】

G 0 1 R 33/26 (2006.01)

G 0 1 R 33/032 (2006.01)

【F I】

G 0 1 R 33/26

G 0 1 R 33/032

【手続補正書】

【提出日】平成26年2月5日(2014.2.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

磁場強度に応じて光の偏光面方位を変化させる媒体を内部に収容したセルと、
光を出射する光源と、
前記光源から出射された光を、第1ビームおよび前記第1ビームと非平行な第2ビームとして前記セルに入射させる光学系と、
前記セルを透過した前記第1ビームの偏光面の方位を検出する第1検出器と、
前記セルを透過した前記第2ビームの偏光面の方位を検出する第2検出器と
を有する磁場測定装置。

【請求項2】

複数の前記セルが平面的に配置されたセルアレイ
を有し、

前記セルアレイは、

第1平板と、

前記第1平板と対向する第2平板と、

前記第1平板および前記第2平板によって挟まれたスペーサーと

を有し、

前記セルは、前記第1平板、前記第2平板、および前記スペーサーによって仕切られることを特徴とする請求項1に記載の磁場測定装置。

【請求項3】

前記第1平板は、前記光を透過する領域を有し、

前記第1ビームおよび前記第2ビームは、前記領域を介して前記セルに入射されることを特徴とする請求項2に記載の磁場測定装置。

【請求項4】

前記光学系は、前記セルアレイに面する第1面と、前記第1面に対向する第2面とで前記第1ビームおよび前記第2ビームを反射させて伝播させるアレイイルミネーターを有し、
前記アレイイルミネーターの第1面には、光分岐手段が設けられ、

前記光分岐手段は、前記第 1 面に入射する光の一部を透過させることを特徴とする請求項 1 ないし 3 のいずれか一項に記載の磁場測定装置。

【請求項 5】

第 1 平板と、
前記第 1 平板と対向する第 2 平板と、
前記第 1 平板および前記第 2 平板によって挟まれたスペーサーと
を有し、
前記第 1 平板、前記第 2 平板、および前記スペーサーによって仕切られるセルが複数形成されている
ことを特徴とするセルアレイ。